第21回日本加速器学会年会

ミュオン選別可能な高感度 ビーム位置モニター開発

宮原 房史#、大谷 将士、三部 勉(KEK)

ミュオン加速器と位置モニター (β>0.7)



測定条件と一般的なビーム診断装置

・ 非常に低いビーム強度

Muon Linac:数個~10⁶個 / パルス 一般的な線形加速器:~10 pC ~ 10 nC / パルス ~10⁸~10¹¹ 個/パルス











Cavity BPM

Screen Monitor

・信号強度が8桁程度低く、ノイズに埋もれてしまう ・10⁶のダイナミックレンジが必要

暗電流とミュオンの区別



- ・暗電流の抑制は困難
- ・電気的な測定では分離は不可能

➡ チェレンコフ光を用いたモニターを開発

チェレンコフ光を用いた粒子識別

誘電体を通過するミュオンからのチェレンコフ光を利用



Examples of kinetic energy and Cherenkov radiation mediums

Energy [MeV]	Radiator Refractive Index <i>n</i>	Num. of photon λ =400-800	$\theta_{Chrenkov}$ [deg]	$\theta_{Chrenkov}$ for electron
40	Rad. Resistant Glass <i>n</i> =1.516	~50 (t=10 mm)	16.6	48.7
212	Silica Aerogel <i>n</i> =1.08	~40 (t=20 mm) (※)	10.9	22.2

※:透過率等は考慮していない

E=40 MeV → 電子から放射されたチェレンコフ光は全反射を繰り返し、 誘電体から出てこない(形状による)

E=212 MeV → 電子から放射されたチェレンコフ光は誘電体前面から 出てくるが、ミュオンから放射されたチェレンコフ光 と角度が異なるため、分離可能

チェレンコフ光測定の難しさ



- ・光の放出角度が大きい
 - → 大きなレンズが必要
 - → ビーム近傍ほど放射線が多く
 レンズが放射線損傷

・発光点の位置が様々

→ 絞り(f値)が小さく被写界深度 が大きな設計が必要

・広波長帯域

→ 収差の小さい大きなレンズが必要 だが特注かつ放射線に弱い

オフナーリレー光学系





- 球面鏡(凹面)とその1/2の径の球面鏡(凸面)で構成
- 倍率 1:1
- 非点収差(焦点距離が光の方向で異なる)以外の収差は 補正される
- ・ 色収差なし
- J-PARCの陽子ビーム2次元プロファイルモニタでも利用



レイトレーシングを用いた評価



3次元レイトレーシング(**Zemax OpticStudio**) を用いてチェレンコフ光に対する応答を調査

- Radiator: n=1.08, L=20 mm
- Single Muon light Source: $\Delta L=0.1 \text{ mm}$, $\Delta \phi=1 \text{ deg}$
- Muon beam $\sigma_x = \sigma_v = 0.9$ mm, n=1000
- Detector resolution: 0.1 x 0.1 mm²
- Mirror: r=560, r=280 mm
- Kinetic Energy 212 MeV
- λ=550 nm (ミラーのみの系では結果に影響しない)

ミュオン1個に対する応答



ミュオンビームに対する応答



単純に重心を求めるだけでビーム位置の評価が可能

円錐鏡を用いたエネルギー測定

β<1 なのでチェレンコフ角に応じて焦点距離が変わる光学系を用意することで、 直線部でもエネルギー測定が可能



- 212 MeVのミュオンのチェレンコフ光が平行光となる様に角度を決めた円錐鏡を2 個設置 (1個でも可能であるが、1個の場合はビーム径が大きくなる)
- アクロマティックレンズで検出器に集光
- 発光点が光軸から外れると大きなコマ収差が発生 → 中心を通ったビームを使う 10

ミュオンのエネルギーと円環サイズ



ミュオンのエネルギーと測定される像

コマ収差 / ビームに対する応答(円錐鏡)

コマ収差



像全体を観測するには大きな 検出器が必要

ビームに対する応答



12

まとめと今後の課題

ミュオン線形加速器でミュオンを暗電流と分離してビーム位置測定可能なモニタの 開発を行っている。

ミュオン選別:シリカエアロゲル(E=212 MeV)、耐放射線ガラス(E=40 MeV)

ビーム位置測定:オフナーリレー光学系を用いて像の重心から評価可能

エネルギー測定:円錐鏡を使った光学系で評価可能

今後の課題

- 最適な光学系設計:分解能、球面鏡のサイズ、視野、誘電体の厚さ、検出器等
- ・ 光学系の試験、誤差評価:分解能評価、ミラー、光学素子、検出器のアライメント
- 検出器のシールド設計:加速管からの放射線をシールド
- エアロゲルの屈折率の不均一性の影響評価
- ・ エアロゲルの放射線耐性、アウトガス対策

謝辞:KEKの三橋利行氏、橋本義徳氏から多くのアドバイスをいただきました。